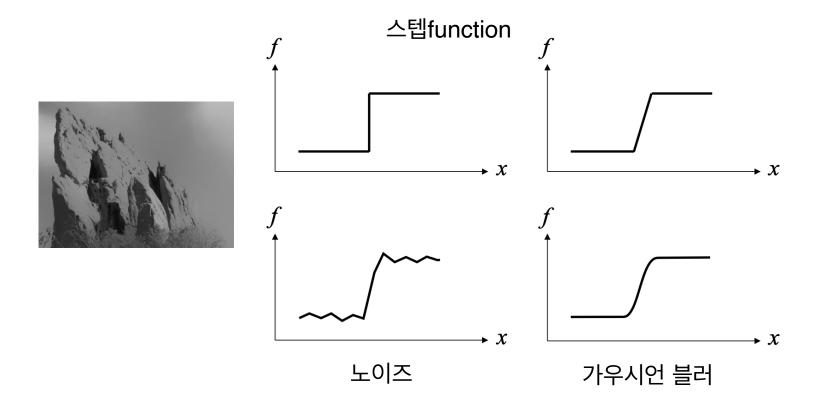
# 영상의 특징 추출

# 학습목표

- •에지의 검출과 미분
- 그래디언트와 에지 검출
- 캐니 에지 검출

# 에지 검출과 미분

- 에지(edge)
  - 영상에서 픽셀의 밝기 값이 급격하게 변하는 부분
  - 일반적으로 배경과 객체, 또는 객체와 객체의 경계



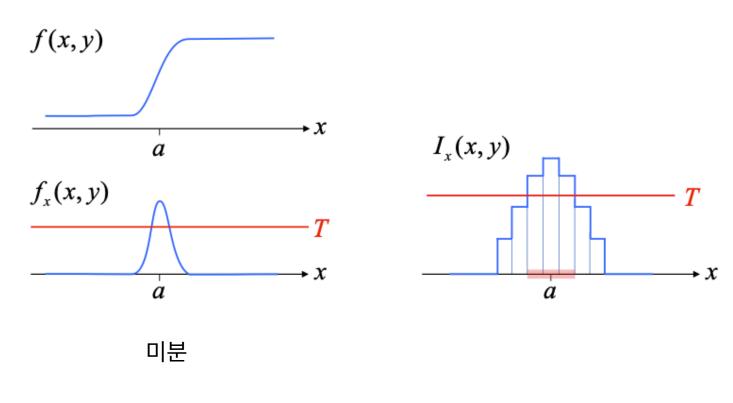
# 에지 검출과 미분

df

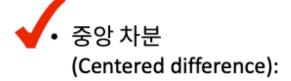
dx

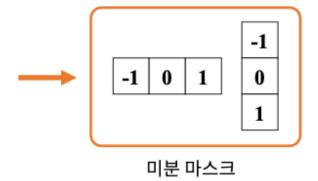
- 기본적인 에지 검출 방법
  - 영상을 (x, y) 변수의 함수로 간주했을 때, 이 함수의 1차 미분(1<sup>st</sup> derivative) 값이 크게 나타나는 부분을 검출

변화율, 순간변화율



- 1차 미분의 근사화(approximation)
  - 전진 차분 (Forward difference):
  - 후진 차분 (Backward difference):

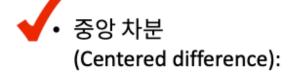




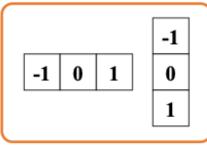
■ 1차 미분의 근사화(approximation)

• 전진 차분 
$$\frac{\partial I}{\partial x} \cong \frac{I(x+h)-I(x)}{h}$$

- 후진 차분 (Backward difference):
- $\frac{\partial I}{\partial x} \cong \frac{I(x) I(x h)}{h}$



$$\frac{\partial I}{\partial x} \cong \frac{I(x+h) - I(x-h)}{2h}$$



미분 마스크

# ■ 다양한 미분 마스크

가로 방향:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-3	0	3
-10	0	10
-3	0	3

세로 방향:

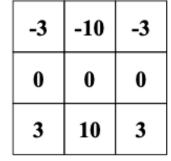
-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Prewitt

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1



Sobel



Scharr 샤르

■ 소벨 필터를 이용한 미분 함수

• src: 입력 영상

• ddepth: 출력 영상 데이터 타입. -1이면 입력 영상과 같은 데이터 타입을 사용.

dx: x 방향 미분 차수.

• dy: y 방향 미분 차수.

dst: 출력 영상(행렬)

• ksize: 커널 크기. 기본값은 3.

• scale 연산 결과에 추가적으로 곱할 값. 기본값은 1.

• delta: 연산 결과에 추가적으로 더할 값. 기본값은 0.

borderType: 가장자리 픽셀 확장 방식. 기본값은 cv2.BORDER\_DEFAULT.

대부분 dx=1, dy=0, ksize=3 또는 dx=0, dy=1, ksize=3 으로 지정.

■ 샤르 필터를 이용한 미분 함수

• src: 입력 영상

• ddepth: 출력 영상 데이터 타입. -1이면 입력 영상과 같은 데이터 타입을 사용.

dx: x 방향 미분 차수.

dy: y 방향 미분 차수.

dst: 출력 영상(행렬)

• scale 연산 결과에 추가적으로 곱할 값. 기본값은 1.

delta: 연산 결과에 추가적으로 더할 값. 기본값은 0.

borderType: 가장자리 픽셀 확장 방식. 기본값은 cv2.BORDER\_DEFAULT.

■ 소벨 필터를 이용한 영상의 미분 예제

```
src = cv2.imread('lenna.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

dx = cv2.Sobel(src, -1, 1, 0, delta=128)
dy = cv2.Sobel(src, -1, 0, 1, delta=128)
```







# 영상의 특징 추출

2) 그래디언트와 에지 검출

■ 영상의 그래디언트(gradient) 🗸

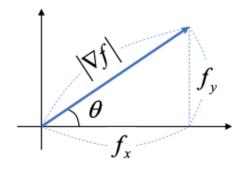


• 함수 f(x, y)를 x축과 y 축으로 각각 편미분(partial derivative)하여 벡터 형태로 표현한 것

$$\nabla f = \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix} = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j}$$

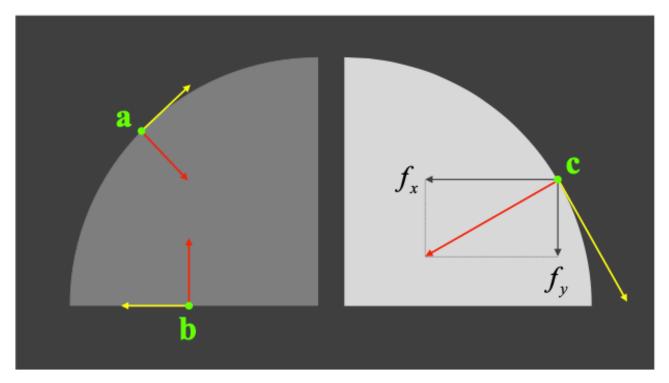
• 그래디언트 크기: 
$$\left|\nabla f\right| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

• 그래디언트 방향: 
$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{f_y}{f_x} \right)$$



- 실제 영상에서 구한 그래디언트 크기와 방향
  - 그래디언트 크기: 픽셀 값의 차이 정도, 변화량
  - 그래디언트 방향: 픽셀 값이 가장 급격하게 증가하는 방향 🧹





■ 2D 벡터의 크기 계산 함수 💉



cv2.magnitude(x, y, magnitude=None) -> magnitude

2D 벡터의 x 좌표 행렬. 실수형. x:

2D 벡터의 y 좌표 행렬. x와 같은 크기. 실수형. y:

• magnitude: 2D 벡터의 크기 행렬. x와 같은 크기, 같은 타입.

 $magnitude(I) = \sqrt{x(I)^2 + y(I)^2}$ 

■ 2D 벡터의 방향 계산 함수 💉



```
cv2.phase(x, y, angle=None, angleInDegrees=None) -> angle
```

2D 벡터의 x 좌표 행렬. 실수형. x:

2D 벡터의 y 좌표 행렬. x와 같은 크기. 실수형. y:

2D 벡터의 크기 행렬. x와 같은 크기, 같은 타입. angle:

angle(I) = atan2(y(I), x(I))

만약 x(I)=y(I)=0이면 angle은 0으로 설정됨.

• angleInDegrees: True이면 각도 단위, False이면 래디언 단위.

#### 그래디언트와 에지 검출

■ 소벨 필터를 이용한 에지 검출 예제

```
src = cv2.imread('lenna.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

dx = cv2.Sobel(src, cv2.CV_32F, 1, 0)
dy = cv2.Sobel(src, cv2.CV_32F, 0, 1)

mag = cv2.magnitude(dx, dy)
mag = np.clip(mag, 0, 255).astype(np.uint8)

dst = np.zeros(src.shape[:2], np.uint8)
dst[mag > 120] = 255
#_, dst = cv2.threshold(mag, 120, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

# 그래디언트와 에지 검출

■ 소벨 필터를 이용한 에지 검출 예제 실행 결과



# 영상의 특징 추출

3) 캐니 에지 검출

■ 좋은 에지 검출기의 조건 (J. Canny)

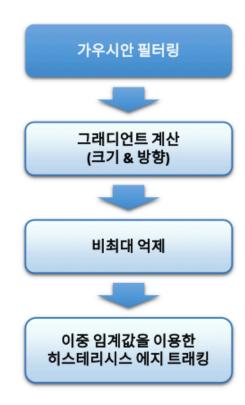
• 정확한 검출(Good detection): 에지가 아닌 점을 에지로 찾거나 또는 에지인데 에지로 찾지 못하는 확률을 최소화

• 정확한 위치(Good localization): 실제 에지의 중심을 검출

• 단일 에지(Single edge): 하나의 에지는 하나의 점으로 표현

- 캐니 에지 검출 1단계
  - 가우시안 필터링
    - (Optional) 잡음 제거 목적

$$G_{\sigma}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$



- 캐니 에지 검출 2단계
  - 그래디언트 계산
    - 주로 소벨 마스크를 사용
    - $\exists$ 7|:  $||f|| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

방향:  $\theta = \tan^{-1}(f_y/f_x)$ 4구역으로 단순화

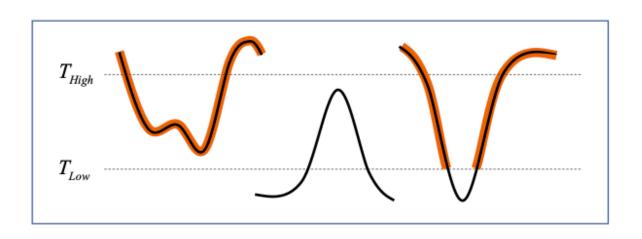


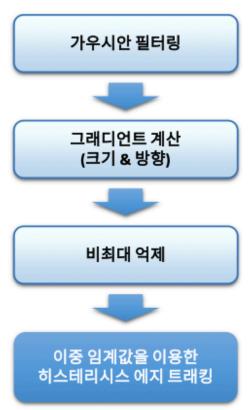
- 캐니 에지 검출 3단계
  - 비최대 억제 (Non-maximum suppression)
    - 하나의 에지가 여러 개의 픽셀로 표현되는 현상을 없애기 위하여 그래디언트 크기가 국지적 최대 (local maximum)인 픽셀만을 에지 픽셀로 설정
    - 그래디언트 방향에 위치한 두 개의 픽셀을 조사하여 국지적 최대를 검사



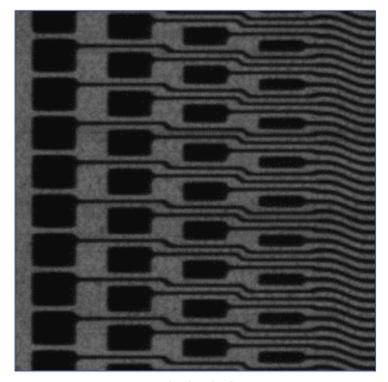


- 캐니 에지 검출 4단계
  - 히스테리시스 에지 트래킹 (Hysteresis edge tracking)
    - 두 개의 임계값을 사용:  $T_{Low}$ ,  $T_{High}$
    - 강한 에지:  $||f|| \ge T_{High}$  → 최종 에지로 선정
    - 약한 에지: T<sub>Low</sub> ≤ ||f|| < T<sub>High</sub>
       → 강한 에지와 연결되어 있는 픽셀만 최종 에지로 선정

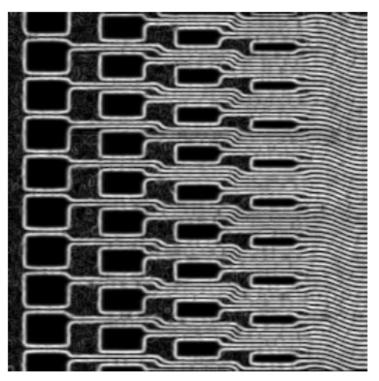




# ■ 캐니 에지 검출 과정

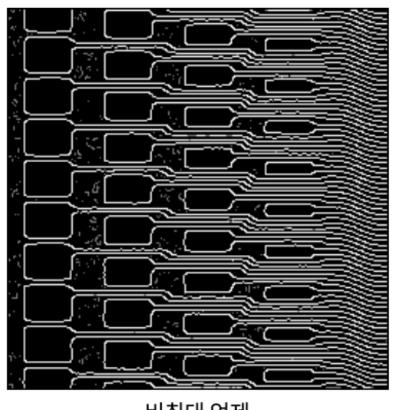


입력 영상 PCB 회로 기판

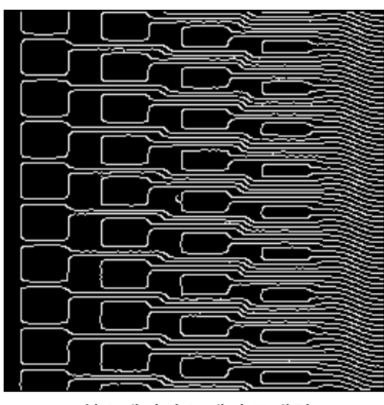


그래디언트 크기

# ■ 캐니 에지 검출 과정



비최대 억제



히스테리시스 에지 트래킹

#### ■ 캐니 에지 검출 함수

• image: 입력 영상

• threshold1: 하단 임계값 } threshold1:threshold2 = 1:2 또는 1:3

• threshold2: 상단 임계값

• edges: 에지 영상

• apertureSize: 소벨 연산을 위한 커널 크기. 기본값은 3.

• L2gradient: True이면 L2 norm 사용, False이면 L1 norm 사용. 기본값은 False.

$$L_2 \text{ norm} = \sqrt{(dI/dx)^2 + (dI/dy)^2}$$
,  $L_1 \text{ norm} = |dI/dx| + |dI/dy|$ 

# ■ 캐니 에지 검출 예제

```
src = cv2.imread('building.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

dst = cv2.Canny(src, 50, 150)
```





threshold1, threshold2

100, 150 50, 200 변경해서 테스트 적절한 값 찾기